

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第2区分

【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公開番号】特開2013-99761(P2013-99761A)

【公開日】平成25年5月23日(2013.5.23)

【年通号数】公開・登録公報2013-026

【出願番号】特願2011-244905(P2011-244905)

【国際特許分類】

B 2 1 D 51/26 (2006.01)

B 6 5 G 47/86 (2006.01)

【F I】

B 2 1 D 51/26 W

B 2 1 D 51/26 J

B 6 5 G 47/86 G

【手続補正書】

【提出日】平成26年6月30日(2014.6.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定の処理を施す処理手段へ容器をボトム吸着手段に吸着させて供給するメインターレットと、前記メインターレットに対峙して容器供給ターレットを有し、

前記メインターレットの容器の受け取り領域に補助ターレットを有し、

前記補助ターレットが、前記受け取り領域において容器のボトム吸着手段へのセンタリングを行うとともに、

前記補助ターレットの周速が、前記メインターレットの周速より速いことを特徴とする容器の処理装置。

【請求項2】

前記補助ターレットのポケットが、容器支持円弧面部と、該容器支持円弧面部から回転方向外周面に延びる導入面とを有し、前記補助ターレットのピッチ円が前記メインターレットのピッチ円に接することを特徴とする請求項1に記載の容器の処理装置。

【請求項3】

前記メインターレットの受け取り開始ポイントの下流側において、前記補助ターレットのピッチ円が、前記メインターレットのピッチ円と接することを特徴とする請求項1又は2に記載の容器の処理装置。

【請求項4】

前記受け取り領域において、前記容器をガイドする受け取り用ガイド部材を有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の容器の処理装置。

【請求項5】

前記所定の処理が、缶体のエンボス加工工程前の加熱処理であり、高周波誘導加熱手段をメインターレットの外周側及び中心側に設置したことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の容器の処理装置。

【請求項6】

前記所定の処理が、缶体のピンホールを検査する光学検査処理であり、照明手段をメインターレットの外周側及び中心側に設置したことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか

一項に記載の容器の処理装置。